

NIMS微細加工共用設備 利用料金表（内部利用）

※2026年4月1日更新

（税抜表示）

No.	装置リスト	NIMS利用者 データ提供あり 及び データ提供非対応 （NIMS所属かつNIMS予算での支出に限る）			NIMS利用者 データ提供なし （NIMS所属かつNIMS予算での 支出に限る）
		機器利用	技術補助	技術代行	機器利用
1	電子ビーム描画装置 [JBX-8100FS]	¥11,000	¥14,200	¥17,400	¥16,500
2	電子ビーム描画装置 [ELS-BODEN100]	¥6,600	¥9,800	¥13,000	¥9,900
3	レーザー描画装置 [DWL66+]	¥4,400	¥7,600	¥10,800	¥6,600
4	マスクレス露光装置 [DL-1000]	¥2,200	¥5,400	¥8,600	¥3,300
5	マスクレス露光装置 [DL-1000/NC2P]	¥4,400	¥7,600	¥10,800	¥6,600
6	マスクレス露光装置 [MLA150]	¥4,400	¥7,600	¥10,800	¥6,600
7	マスクレス露光装置 [DL-1500iS2]	¥4,400	¥7,600	¥10,800	¥6,600
8	HMDSベーク処理装置 [APPS-30]	¥2,200	¥5,400	¥8,600	¥3,300
9	自動現像装置 [AD-1200]	¥2,200	¥5,400	¥8,600	¥3,300
10	水蒸気プラズマ洗浄装置 [AQ-500 #1]	¥2,200	¥5,400	¥8,600	¥3,300
11	水蒸気プラズマ洗浄装置 [AQ-500 #2]	¥2,200	¥5,400	¥8,600	¥3,300
12	UVオゾンクリーナー [UV-1]	¥2,200	¥5,400	¥8,600	¥3,300
13	蒸気二流体洗浄装置 [SSM101]	¥2,200	¥5,400	¥8,600	¥3,300
14	スパッタ装置 [JSP-8000]	¥2,200	¥5,400	¥8,600	¥3,300
15	スパッタ装置 [CFS-4EP-LL #2]	¥2,200	¥5,400	¥8,600	¥3,300
16	スパッタ装置 [CFS-4EP-LL #3]	¥2,200	¥5,400	¥8,600	¥3,300
17	スパッタ装置 [CFS-4EP-LL #4]	¥2,200	¥5,400	¥8,600	¥3,300
18	電子銃型蒸着装置 [RDEB-1206K]	¥2,200	¥5,400	¥8,600	¥3,300
19	電子銃型蒸着装置 [ADS-E86]	¥2,200	¥5,400	¥8,600	¥3,300
20	電子銃型蒸着装置 [ADS-E810]	¥2,200	¥5,400	¥8,600	¥3,300
21	原子層堆積装置 [SUNALE R-150]	¥2,200	¥5,400	¥8,600	¥3,300
22	原子層堆積装置 [AD-230LP]	¥2,200	¥5,400	¥8,600	¥3,300
23	原子層堆積装置 [TFS200]	¥4,400	¥7,600	¥10,800	¥6,600
24	SiO2プラズマCVD装置 [PD-220NL]	¥2,200	¥5,400	¥8,600	¥3,300
25	SiNプラズマCVD装置 [PD-220NL]	¥2,200	¥5,400	¥8,600	¥3,300
26	CCP-RIE装置 [RIE-200NL]	¥2,200	¥5,400	¥8,600	¥3,300
27	ICP-RIE装置 [RIE-101iPH]	¥2,200	¥5,400	¥8,600	¥3,300
28	ICP-RIE装置 [RV-APS-SE]	¥4,400	¥7,600	¥10,800	¥6,600
29	ICP-RIE装置 [CE300I]	¥2,200	¥5,400	¥8,600	¥3,300
30	シリコンDRIE装置 [ASE-SRE]	¥2,200	¥5,400	¥8,600	¥3,300
31	原子層エッチング装置 [PlasmaPro 100 ALE]	¥2,200	¥5,400	¥8,600	¥3,300
32	低ダメージ精密エッチング装置 [Spica #1]	¥4,400	¥7,600	¥10,800	¥6,600
33	低ダメージ精密エッチング装置 [Spica #2]	¥4,400	¥7,600	¥10,800	¥6,600
34	イオンビームミリング複合装置 [16IBE]	¥4,400	¥7,600	¥10,800	¥6,600
35	赤外線ランプ加熱装置 [RTP-6 #2]	¥2,200	¥5,400	¥8,600	¥3,300
36	赤外線ランプ加熱装置 [RTP-6 #3]	¥2,200	¥5,400	¥8,600	¥3,300
37	FE-SEM [S-4800]	¥2,200	¥5,400	¥8,600	¥3,300
38	FE-SEM+EDX [S-4800]	¥4,400	¥7,600	¥10,800	¥6,600
39	FE-SEM+EDX [SU8000]	¥4,400	¥7,600	¥10,800	¥6,600
40	FE-SEM+EDX [SU8230]	¥4,400	¥7,600	¥10,800	¥6,600
41	FE-SEM+EDX [JSM-IT800]	¥2,200	¥5,400	¥8,600	¥3,300
42	卓上電子顕微鏡 [TM3000]	¥2,200	¥5,400	¥8,600	¥3,300
43	走査型プローブ顕微鏡 [Jupiter XR]	¥2,200	¥5,400	¥8,600	¥3,300
44*	レーザー顕微鏡 [LEXT OLS4000]	¥2,200	¥5,400	¥8,600	¥3,300
45*	触針式プロファイラー [Dektak XT-A #1]	¥2,200	¥5,400	¥8,600	¥3,300
46*	触針式プロファイラー [Dektak XT-A #2]	¥2,200	¥5,400	¥8,600	¥3,300
47*	エリブソメーター [MARY-102FM]	¥2,200	¥5,400	¥8,600	¥3,300
48*	分光エリブソメーター [M2000]	¥2,200	¥5,400	¥8,600	¥3,300
49*	分光エリブソメーター [UNECS-2000A]	¥2,200	¥5,400	¥8,600	¥3,300
50*	顕微分光膜厚計 [F54-XY-200-UV]	¥2,200	¥5,400	¥8,600	¥3,300
51*	薄膜応力測定装置 [FLX-2000-A]	¥2,200	¥5,400	¥8,600	¥3,300
52*	ダイシングソー [DAD322]	¥2,200	¥5,400	¥8,600	¥3,300
53*	ダイシングソー [DAD3220]	¥2,200	¥5,400	¥8,600	¥3,300
54*	室温ブローバー [MX-200/B]	¥2,200	¥5,400	¥8,600	¥3,300
55*	ワイヤーボンダー [7476D #1]	¥2,200	¥5,400	¥8,600	¥3,300
56*	ワイヤーボンダー [7476D #2]	¥2,200	¥5,400	¥8,600	¥3,300
57*	ウェットステーション	¥2,200	¥5,400	¥8,600	¥3,300
58*	CAD (描画データ) 作成システム	¥2,200	¥5,400	¥8,600	¥3,300
59*	クリーンルーム設備	¥2,200	¥5,400	¥8,600	¥3,300

*装置単体でのデータ登録非対応装置

【備考】

- 1, 上記表は、1時間当たりの利用に係る料金単価（税抜）であり、これに利用時間（※）を乗じます。
 - 2, 15分未満の利用については15分として算出し、以後15分単位で利用料金を算出します。
 - 3, 「機器利用」は、機器利用ライセンス取得後、利用者のみで装置を使用する利用形態です。
 - 4, 「技術補助」は、機器利用ライセンス取得のために、操作トレーニングを受ける利用形態です。
 - 5, 「技術代行」は、利用者の代わりに、施設スタッフが試料の作製等を代行する利用形態です。
 - 6, 「技術補助・技術代行」の単価は、装置利用料金も含んだ価格です。
 - 7, ロッカー等を定期的に使用（占有）する場合は、クリーンルーム設備の利用として課金します。
 - 8, 成膜装置で金(Au)を成膜する場合は、膜厚に応じたAu使用料を課金します。
- ※ 利用時間は、装置予約時間（＝装置占有時間：装置の立ち上げ／終了作業時間含む）です。